令和５年３月１日

三次元半導体研究センター
ご利用の皆様

公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
理事長　　津田　純嗣
（三次元半導体研究センター）

新型装置の導入等に伴う機器利用料金表改定について（お知らせ）

拝啓

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り誠にありがとうございます。

このたび、当センターに新たに導入した「プリント基板用直接描画装置」等が供用開始となるため、利用料金を設定いたしました。

あわせて、昨今の光熱水費等の高騰を踏まえ、一部既存機器の利用料金の改定を行っております。

今後も研究開発支援を通じて、より一層皆様のお役に立てるよう努力してまいりますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

１　新規導入機器の利用料金について（令和５（2023）年３月 15 日より適用）

機器名	設置場所	料金（税抜・1時間）
プリント基板用直接描画装置 （SCREEN PE ソリューションズ社製：LI-7F-M）	クリーンルームB	29,800
熱衝撃試験機 （エスペック社製：TSA-43EL）	実装エリア	3,500
ダブルパルステスター （キーサイトテクノロジー社製：PD1500A）	電気特性評価室	5,500

２　一部既存機器の利用料金の改定について（令和５（2023）年４月１日より適用）
詳細は別添「機器利用料金単価表」をご確認ください。

＜本件に関するお問い合わせ先＞
公益財団法人福岡県産業・科学技術振興財団
三次元半導体センター　管理グループ
担当：本松・河津・小野
TEL:092-331-8510 / E-Mail: jiss-itoshima@ist.or.jp

（別紙1）

三次元半導体研究センター　機器利用料金単価表

（令和5年4月1日改訂）

No.	機器名	設置場所	現行料金（税抜）	改定料金（税抜）
1	基板クランプ機構付き真空式ロールコーター	クリーンルームB	4,600	4,600
7	ソルダーレジスト乾燥炉	クリーンルームB	2,400	3,000
9	予熱ラミネーター	クリーンルームB	2,400	3,200
11	クリーンローラ	クリーンルームB	1,700	2,400
12	フィルムレジスト圧着装置	クリーンルームB	5,400	6,300
21	プリント基板用直接描画装置（LI-7F-M）	クリーンルームB	22,500	29,800
23	エッチング処理後乾燥炉	クリーンルームB	2,000	3,000
30	プリント基板用プラズマクリーナー	クリーンルームB	6,100	6,900
33	AOI(光学式外観検査装置)	クリーンルームB	10,700	10,700
73	パーティクルカウンター	クリーンルームB	600	600
66	マイクロフォーカスX線透視装置	クリーンルームC	3,200	4,100
43	ガラス(支持)基板貼合せ装置	クリーンルームD	4,900	5,700
44	ガラス(支持)基板剥離装置	クリーンルームD	7,600	8,400
45	照射器移動方式紫外線照射装置	クリーンルームD	2,200	3,000
46	オートマチックサーフェースグラインダー	クリーンルームD	10,700	11,500
48	オートマチックダイシングソー	クリーンルームD	7,000	7,800
49	ストレスリリーフ装置	クリーンルームD	9,500	10,300
R1	高温クリーンオーブン	クリーンルームD	7,000	8,500
47	8インチ用ウェハマニュアル洗浄装置	クリーンルームE	2,800	3,600
53	ウェハーカップ式銅メッキ装置	クリーンルームE	13,500	14,300
55	半導体用クリーンルーム対応リフロー炉	クリーンルームE	7,500	8,300
69	超純水製造装置	クリーンルームE	600	1,200
50	リアクティブイオンエッチャー	クリーンルームF	15,000	15,700
51	絶縁膜形成装置	クリーンルームF	14,000	14,700
52	縦型酸化炉	クリーンルームF	7,500	8,200
54	超小型蒸着装置	クリーンルームF	5,500	6,300
65	電界放出型分析走査電子顕微鏡システム	クリーンルームF	12,400	13,300
67	光学顕微鏡	クリーンルームF	1,400	1,400
68	実体顕微鏡	クリーンルームF	2,700	1,400
40	微細パターン加工装置	クリーンルームG	16,500	17,300
41	スピンコーター	クリーンルームG	4,000	4,900
42	アルカリデベロッパー	クリーンルームG	4,600	5,400
14	アンダーフィル塗布機	実装エリア	1,300	1,300
15	メタルマスク洗浄装置	実装エリア	1,300	1,300
16	プリント基板用高速スクリーン印刷機	実装エリア	4,500	5,300
17	プロダクションモジュラー	実装エリア	5,200	6,000

No.	機器名	設置場所	現行料金（税抜）	改定料金（税抜）
18	導通試験テストデータ加工データ作成装置	実装エリア	3,600	3,600
19	大型基板対応フリップチップボンダ	実装エリア	12,000	12,200
24	鉛フリー対応N2リフロー装置	実装エリア	5,000	5,800
26	真空密閉型超音波洗浄装置	実装エリア	4,100	5,000
32	内蔵部品検査装置	実装エリア	7,900	8,700
R5	熱衝撃試験機	実装エリア		3,500
13	基板処理前乾燥炉	水平ライン室	2,400	3,000
27	基板用現像装置	水平ライン室	9,300	11,200
28	ソフトエッチ水洗装置	水平ライン室	7,700	9,700
29	レジスト剥離装置	水平ライン室	12,700	14,500
31	基板用ケミカルエッチング装置	水平ライン室	10,900	12,900
25	基板用バフ研磨装置	めっきライン室	7,500	7,500
34	積層前粗化処理装置	めっきライン室	9,900	11,700
35	デスミア装置	めっきライン室	12,400	14,200
36	基板用無電解めっき装置	めっきライン室	10,300	12,200
37	電解ビアフィルめっき装置	めっきライン室	10,600	12,600
3	プリント基板用X線ガイド穴明機	機械加工室	5,000	5,900
4	プリント基板穴明機	機械加工室	5,700	6,500
5	プリント基板外形加工機	機械加工室	4,600	5,400
8	ピン立て装置	機械加工室	2,500	3,200
20	プリント配線板用UV＋CO2レーザ加工機	機械加工室	15,000	15,800
60	恒温恒湿振動試験機	信頼性試験室	7,300	8,100
61	衝撃試験装置	信頼性試験室	7,500	8,300
62	自動切断機	信頼性試験室	900	900
63	自動研磨機(64 研磨濾過器含む）	信頼性試験室	3,400	4,100
57	プロービングシステム	電気特性評価室	2,600	3,400
R3	プロービングシステム（120GHz）	電気特性評価室	3,600	4,200
58	高周波パラメータ測定システム	電気特性評価室	11,000	11,900
59	TDRオシロスコープ	電気特性評価室	4,800	5,500
74	基板パラメータ測定システム	電気特性評価室	2,100	2,900
R2	120GHzネットワークアナライザ	電気特性評価室	18,000	18,600
R4	ダブルパルステスター	電気特性評価室		5,500
2	プリント基板真空プレス装置	プレス室	9,900	10,700
38	自動滴定分析機	分析室	900	900
39	CVS	分析室	2,900	2,900
L1	レーザー顕微鏡	検査室	3,800	4,700
L2	フリップチップボンダー	クリーンルームC	10,800	11,600
L3	ワイヤーボンダー	クリーンルームC	5,700	5,700
L4	ボンドテスタ	クリーンルームC	3,200	4,000

No.	機器名	設置場所	現行料金（税抜）	改定料金（税抜）
L5	FIB	クリーンルームC	12,500	13,400
L7	ウエハープラズマクリーナー	クリーンルームC	4,500	5,300
L8	酸化膜エッチング装置	クリーンルームC	8,300	9,100
L9	ピール試験機	検査室	2,500	3,300
L10	マイグレーション評価装置	信頼性試験室	2,500	2,500
s1	ウエハ銅ポストめっき	クリーンルームE	3,500	4,300
s2	SnAgめっき	クリーンルームE	3,500	4,300
s3	Niめっき	クリーンルームE	3,500	4,300
s4	Ni/Auめっき	クリーンルームE	50,000	50,800
s5	チタン/Cu　スパッタ	クリーンルームE	40,000	40,600
s6	二流体洗浄装置	クリーンルームE	5,000	5,800
s7	基板用Ni/Auめっき	水平ライン室	100,000	102,000
s8	PRパルスCu	クリーンルームE	3,500	4,300
E43	デジタルマイクロスコープ	クリーンルームC	800	1,400